

Type A Sensor for Quartz Crystal Deposition Controllers

自动晶体切换最大限度地缩短了生产时间

与 OLED 工艺相关的低密度材料和低沉积速率要求薄膜沉积控制器和传感器具有极高的精度和可靠性。要保持速率和厚度精度，就必须进行持续的速率控制。

为进一步减少停机时间，可将晶体预装到第二个可选的旋转盘中，然后快速、轻松地与装有用完晶体的旋转盘交换，从而最大限度地减少系统的开放时间。

利用 INFICON Cygnus® 2 充分利用晶体交换器

如果将电动晶体传感器与 INFICON Cygnus 2 薄膜沉积控制器配合使用，您将从该传感器中获得最大的收益。

Cygnus 2 由薄膜仪器市场的领导者 INFICON 开发，是唯一一款专为 OLED 制造业设计的薄膜控制器。最多可同时、独立或任意组合控制六个源。这意味着 Cygnus 2 可以最大限度地提高最复杂、最苛刻和最独特的 OLED 应用的吞吐量。

特点

- 步进电机接收来自电机驱动器的信号（脉冲），通过稳健的自动切换功能保持所有晶体，最大限度地延长工艺正常运行时间
- 结构紧凑，在同类产品中体积最小
- 易于拆卸的转盘可快速更换所有晶体
- 易于拆卸的前沉积防护罩可保护晶体和转盘，防止材料堆积，从而最大限度地减少拆卸整个传感器进行维护的需要
- 利用步进电机对晶体进行精确的位置控制
- 包括用于转盘和斩波器的电机驱动器，不包括驱动控制器（电机驱动器可独立控制步进电机，无需驱动控制器）



规格

最大烘烤温度（无冷却情况下）	50°C (以电机表面为准)
在最小冷却流量条件下的最高等温运行环境温度	190°C (以转盘盖表面为准)
产品尺寸	详见下方图纸
电源电压（电机运行）	24V 直流电 (DC)，含转盘与切换器的步进电机驱动器
水/气管标准长度	2000 毫米
同轴电缆标准长度	1700 毫米
晶体更换方式	前置安装式

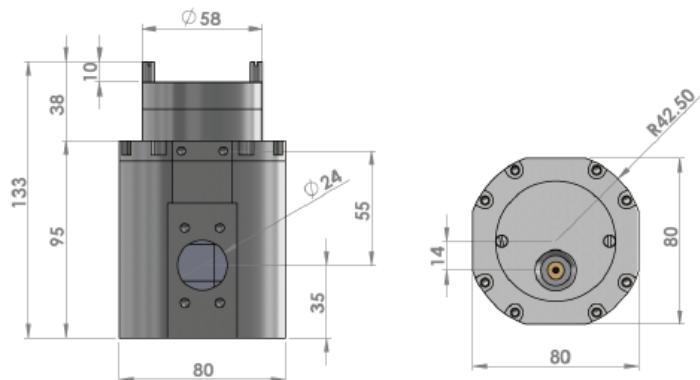
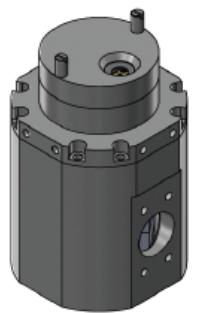
材料

机械结构件、屏蔽罩、切换器、本体、转盘	SS304 不锈钢
弹簧、电子触点、轴承盖	镀金铍铜 (Au 镀 BeCu) 、镀金无氧高导铜 (Au 镀 OFHC)
连接器	SS304 不锈钢
绝缘材料	PEEK (聚醚醚酮)
切换器联轴器	Vespel (高性能工程塑料)
磁液密封	SS304 和 SS630 不锈钢
晶体尺寸	14 毫米 (0.550 英寸)
水/气管路	Teflon® (特氟龙) 材质

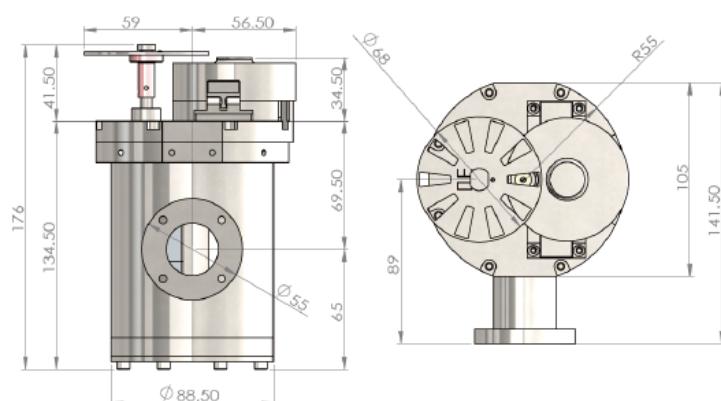
尺寸

(单位毫米)

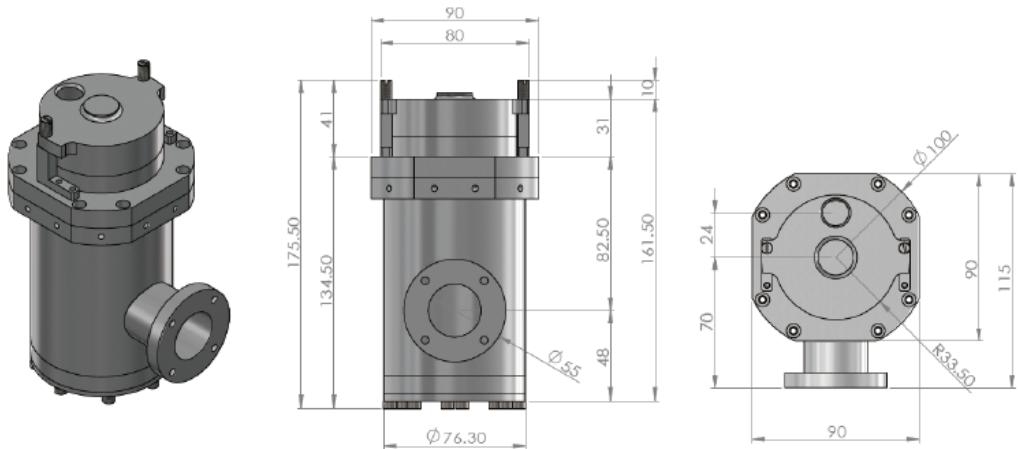
5A 型传感器 (不带斩波器) 尺寸



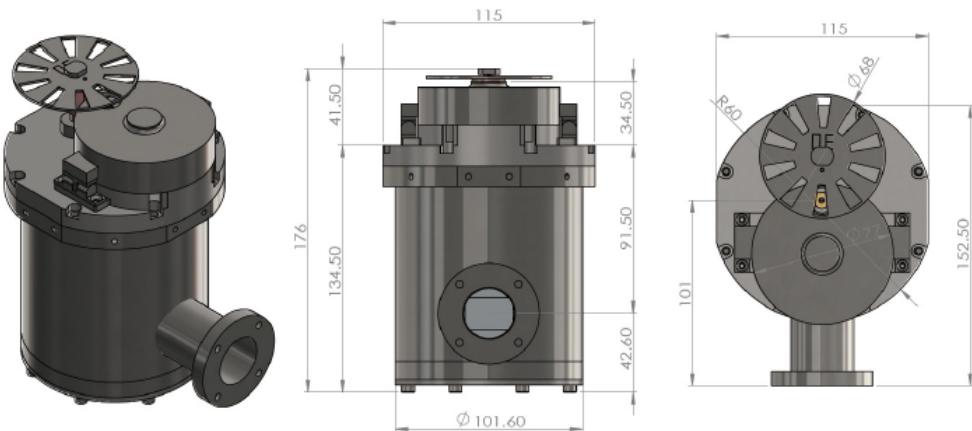
10A 型传感器 (带斩波器) 尺寸



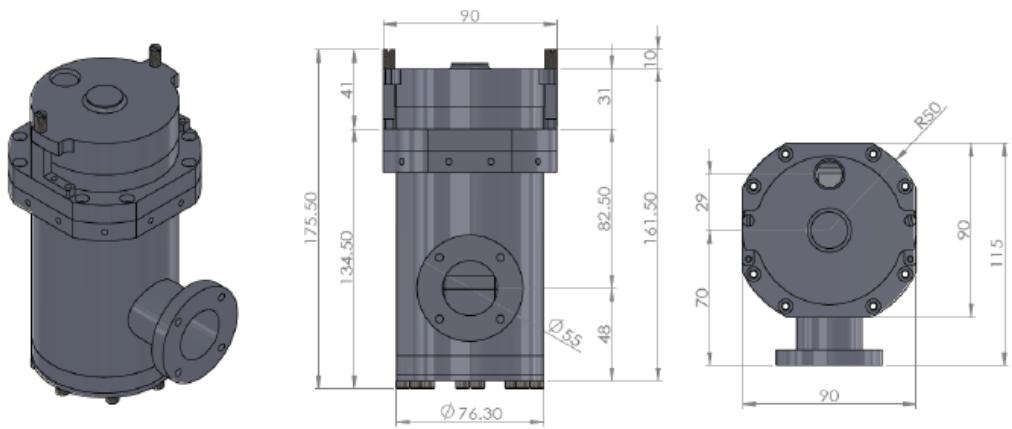
10A 型传感器（不带斩波器）尺寸



12A型传感器(带斩波器)尺寸



12A型传感器(不带斩波器)尺寸



配置选项

Motorized Crystal Sensor

(Example: MC10101)

Type of sensor (includes motor driver, crystal sold separately)

- Motor Crystal Exchanger 5 Sensor (no chopper type)
 Motor Crystal Exchanger 10 Sensor.....
 Motor Crystal Exchanger 12 Sensor.....

Chopper wheel

- None.....
 Chopper wheel.....

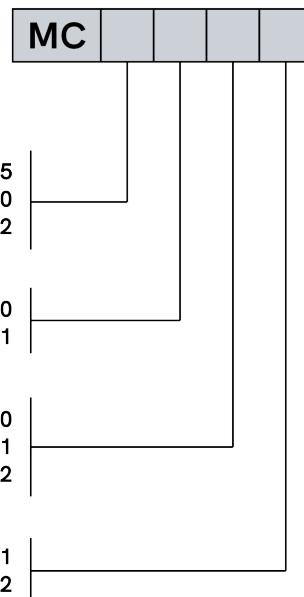
Signal cable length

- Customer specific request.....
 1 m.....
 4 m.....

Bellows (with adapter*)

- None.....
 0.5 m.....

*Bellows and adapter for installation



NOTE 1:
 Custom parts and other
 non-standard parts available -
 Consult factory

NOTE 2:
 Type 5A sensor - Chopper type
 is not available

